

# TPSS熱処理用高純度SiC

## TPSS High-purity SiC for Heat Treatment Process

高純度SiとSiCとの複合材料。酸化・拡散・LP-CVDなどの熱処理工程に最適

"TPSS" is a compound material of high-purity Si and SiC, and it is widely used in various heat treatment processes in the semiconductor field, including oxidation, diffusion, LP-CVD processes, etc.

高純度CVDコート、高精度加工で最先端プロセスに対応

"TPSS" contributes to cutting-edge heat treatment and CVD processes due to its high purity and high machining technology.

シェアNo.1のトップブランド

"TPSS" is the top brand among SiC products, and we are proud of its No.1 market share in the heat treatment process field.

### 高品質ウェーハを実現するウェーハ移載面への自動精密加工技術

Automatic precision processing technology for wafer loading surface leads to high-quality wafers

φ300 高品質アニールウェーハに、ウェーハポートへの自動精密加工が貢献。  
パーティクルフリー、スリップフリー実現に寄与。

Automatic precision processing technology contributes to high-quality φ300mm annealed wafers that are particle-free and slip-free.

### 自動ベベリング Automatic beveling

ウェーハ積載部端面の鋭利なエッジを自動的に面取り(Ra=0.5 ~ 2.0 μm)

Automatic beveling is a technology for automatically beveling (Ra=0.5 ~ 2.0 μm) the sharp edges of wafer loading surfaces.

■自動ベベリングを施したウェーハポート例 Example of wafer boats with automatic beveling

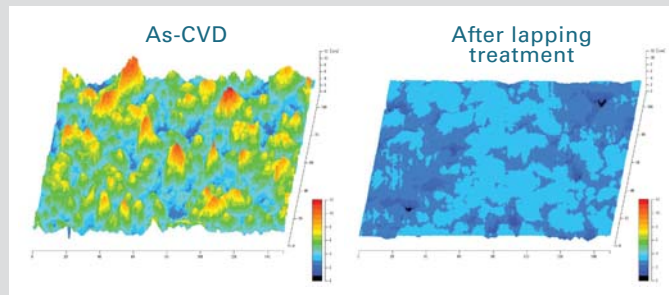


### 自動ラッピング Automatic lapping

高純度 CVD-SiC コーティング面の凹凸を機械研磨。ウェーハ積載移載面を Ra=0.5 μm程度に平坦化

Automatic lapping is a technology for automatically polishing the surface irregularities of high-purity CVD-SiC coating surfaces, leveling the wafer loading surface down to Ra=0.5 μm.

■自動ラッピング加工結果 Auto lapping results



■グレード別化学分析例

Example of chemical analysis by grade

(Units:ppm)

Grade	Fe	Cu
TPSS-U	2.5	<0.1
TPSS-CU	0.04	<0.1

※加圧酸抽出法により試料を調整し、原子吸光度計で評価しました。  
Test samples were prepared with the pressurized acid solution method and analyzed by atomic absorption spectroscopy. TPSS-CU represents the analysis values of the CVD film.

**COVALENT**

コバレントマテリアル株式会社

セラミックス事業本部

東京都品川区大崎1-6-3 日精ビルディング 〒141-0032

Tel:03-5437-8408 Fax:03-5437-7395 E-mail:tps\_j331@covalent.co.jp

www.covalent.co.jp